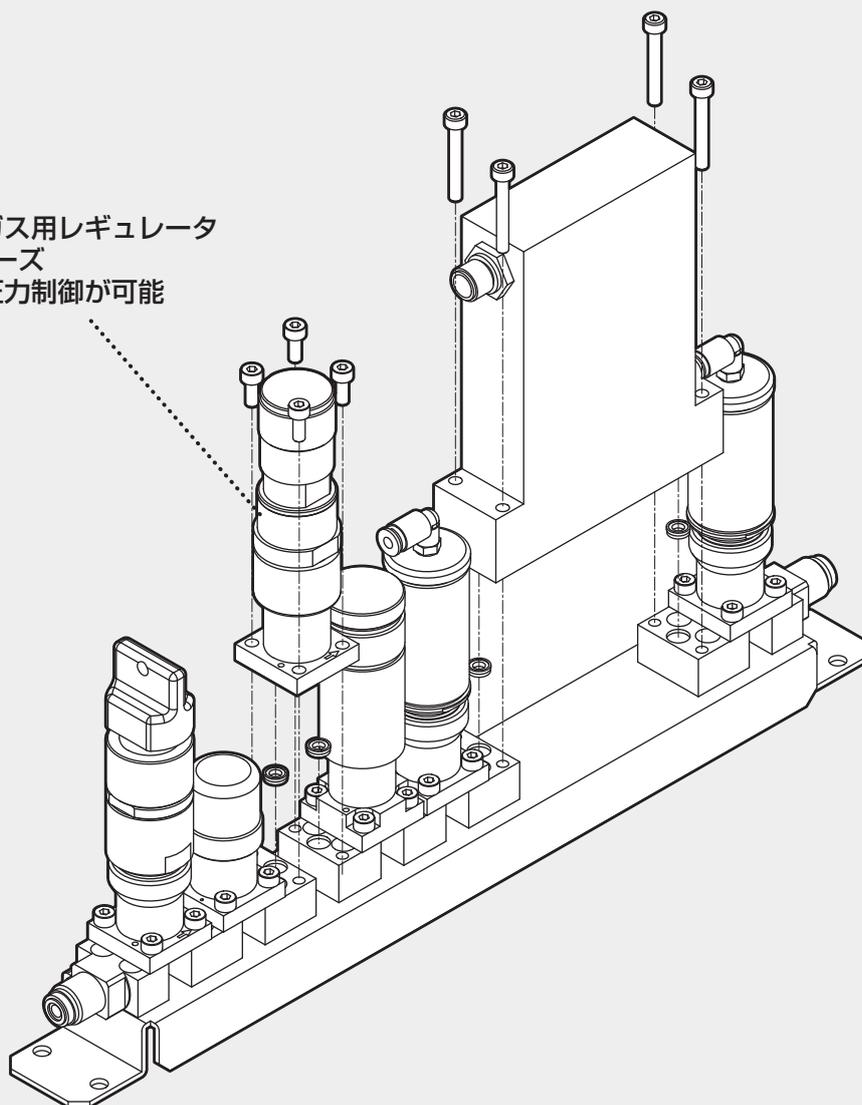


省スペース、 メンテナンス性が一挙に大幅向上。

概要

本システムは、半導体製造装置のガス供給ライン用に開発されたもので、SEMIで規格化されたサーフェスマウント型のアオペレートバルブ・マスフローコントローラ等を、コンパクトに集積化したものです。お客様のご要望フローに合わせて、最適なレイアウトを行い、従来、溶接継手により構成していたシステムに比べ大幅な省スペースを実現します。

●プロセスガス用レギュレータ
PGMシリーズ
高精度な圧力制御が可能



PAT.

LG Dシリーズ

MAGD/OGD/
MGDRシリーズ

高耐久タイプ

その他プロセス
ガス用バルブ

レギュレータ

集積化ガス
供給システム

使用上の
注意事項

エアオペレート
バルブ

マニュアル
バルブ

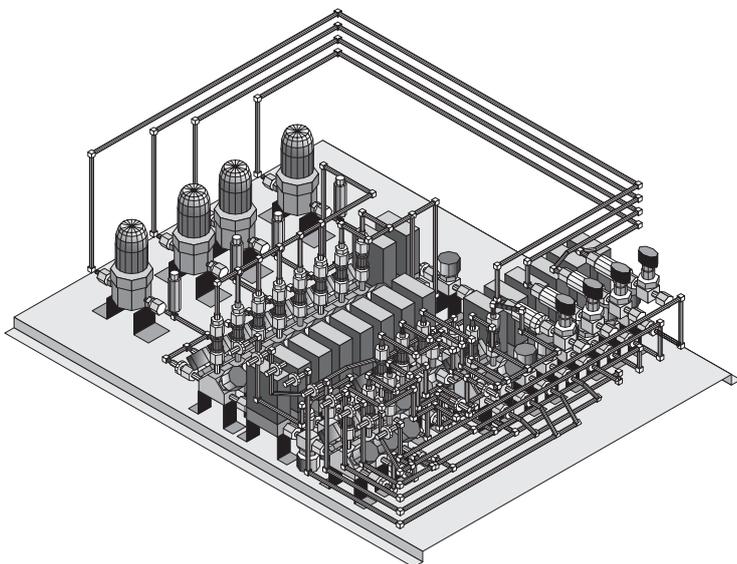
真空圧力制御
バルブ

使用上の
注意事項

関連機器

主な特長

既存ガスジャングル



フットプリントの減少

- ・フットプリント 従来比 60%
- ・容積 従来比 16%

施工性の向上

- ・構成パーツ上部一方向からのパーツ脱着可能
- ・ヒーティングの簡素化

信頼性の向上

- ・CSシール/Wシールの採用

耐食性の向上(コンタミレス)

- ・溶接箇所80%以上減少
溶接部を激減させることで、従来に比べ汚染の要因を大幅に減らしました。

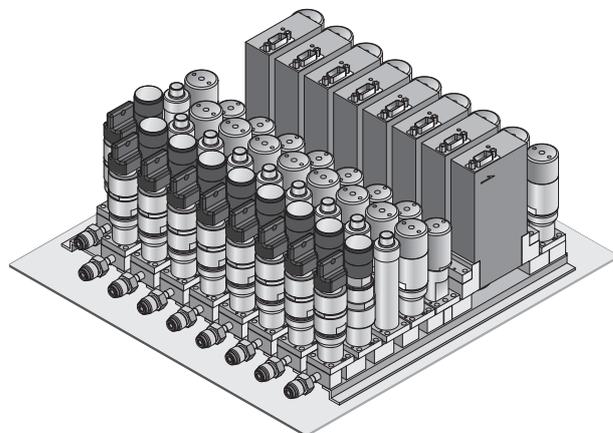
置換特性の向上

- ・内部容積、デッドボリュームが極小な流路構成
- ・パーズの改善

標準化の推進

- ・構成パーツの標準化推進

集積化ガス供給システム



LGDシリーズ

AGD/OGD/MGDRシリーズ

高耐久タイプ

プロセスガス用機器
その他プロセスガス用バルブ

レギュレータ

集積化ガス供給システム

使用上の注意事項

エラオペレイトバルブ

マニュアルバルブ

真空圧力制御バルブ

使用上の注意事項

プロセスガス用機器

高真空用機器

関連機器

Integrated Gas System Series

集積化ガス供給システムヒストリー

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

LG Dシリーズ

MAGD / OGD /
MGDRシリーズ

高耐久タイプ

その他プロセス
ガス用バルブ

レギュレータ

集積化ガス
供給システム

使用上の
注意事項

エアオペレイト
バルブ

マニュアル
バルブ

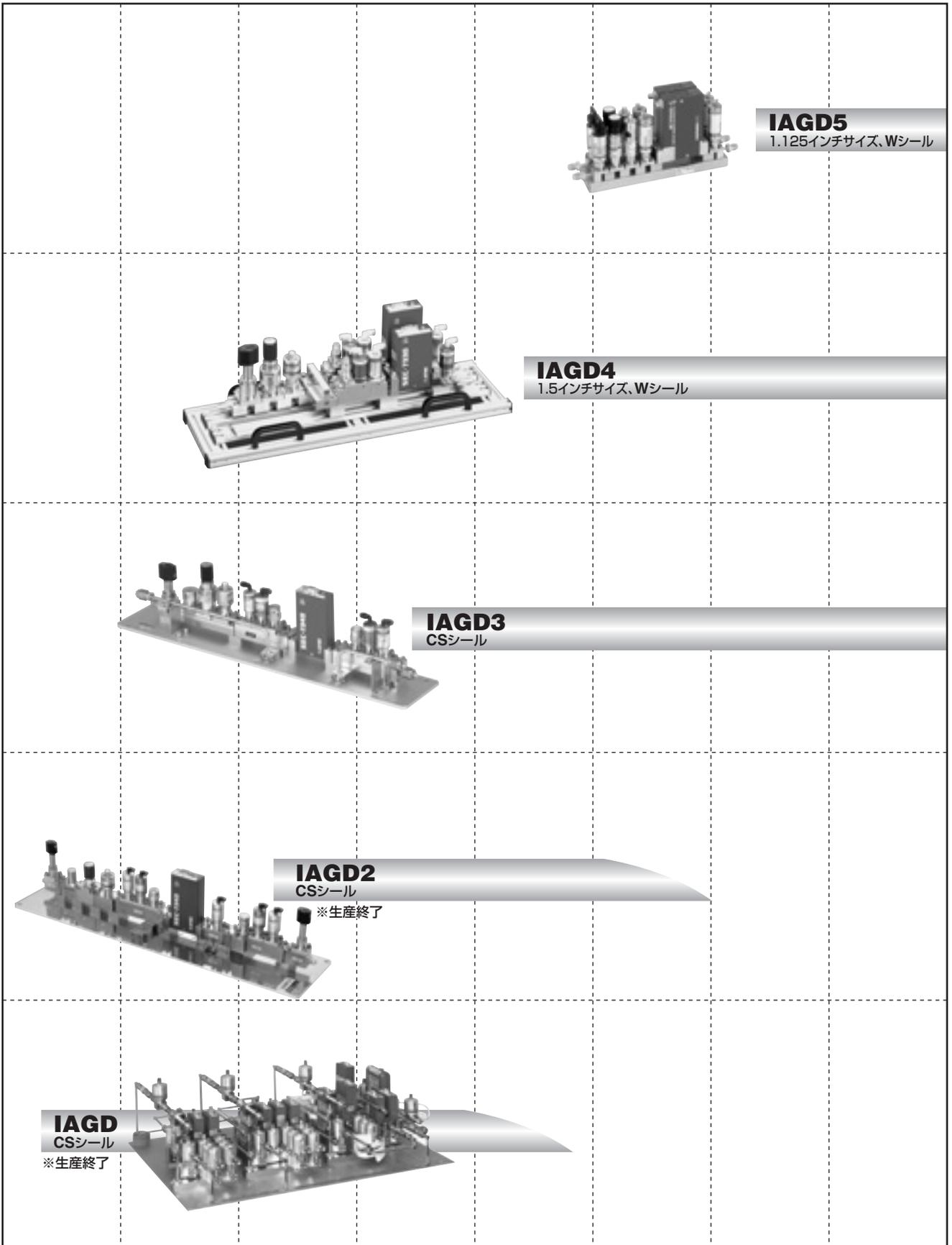
真空圧力制御
バルブ

使用上の
注意事項

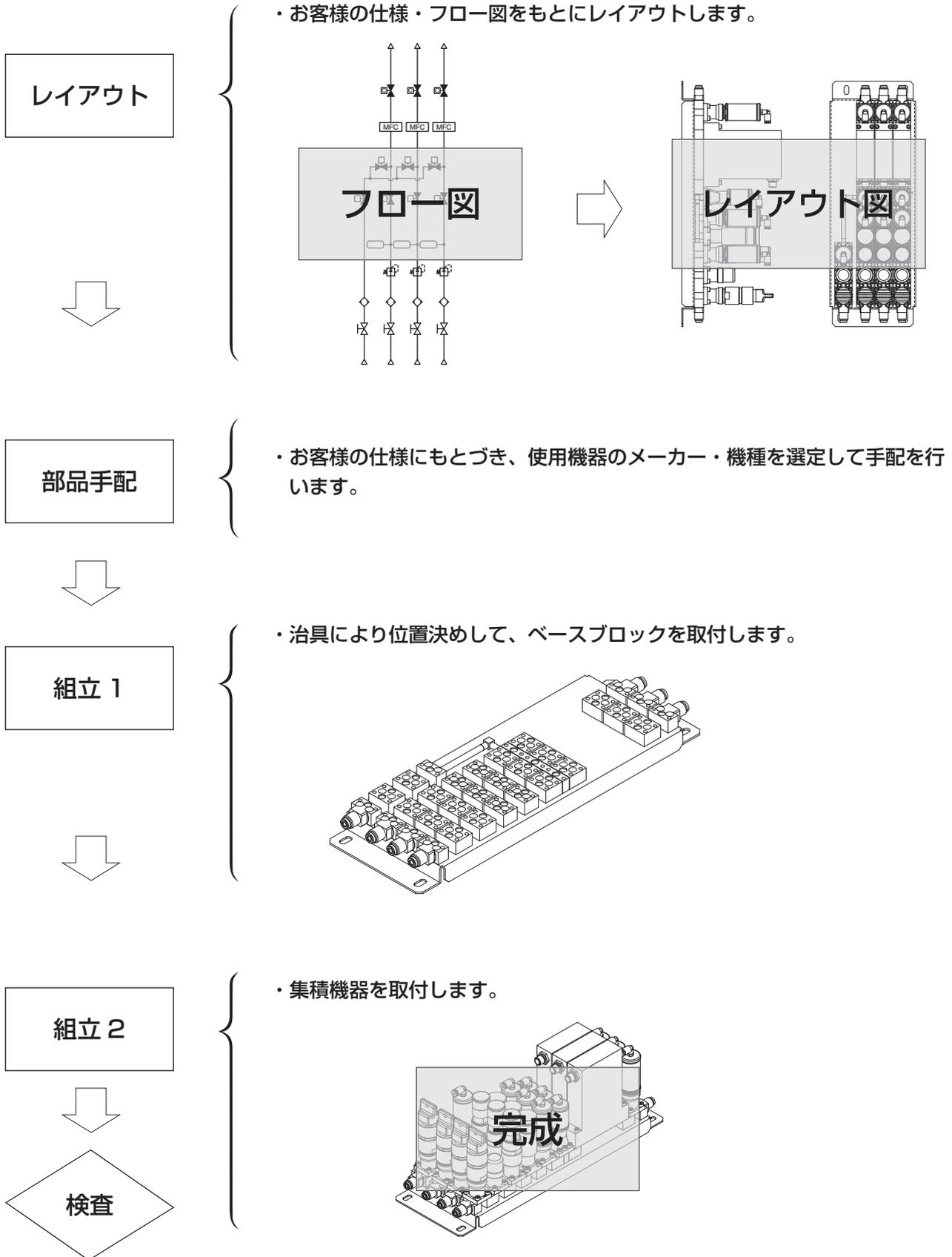
関連機器

プロセスガス用機器

高真空用機器



集積化ガス供給システム製作の流れ



LG Dシリーズ

AGD / OGD / MGD / Rシリーズ

高耐久タイプ

プロセスガス用機器
その他プロセス
ガス用バルブ

レギュレータ

集積化ガス
供給システム

使用上の
注意事項

エアオペレイト
バルブ

ミニアル
バルブ

高真空用機器
真空圧力制御
バルブ

使用上の
注意事項

関連機器